

INFULL (Indian (IN) Patents Full Text)



収録範囲	全技術分野		
ファイル種類	全文データベース		
特徴	シソーラス	国際特許分類 (/IPC), 共通特許分類 (/CPC) ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO)	
	アラート (自動 SDI 検索)	毎週 (デフォルト), 毎月	
	CAS RN® (CAS 登録番号) <input type="checkbox"/>	ページイメージ <input type="checkbox"/>	STN AnaVist <input type="checkbox"/>
	Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/>	中間一致・ 後方一致検索 <input checked="" type="checkbox"/>	STN Easy <input type="checkbox"/>
	練習用ファイル <input type="checkbox"/>	構造図 <input type="checkbox"/>	
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> ・インド特許庁発行の公開特許、公告特許、登録特許の全文情報 (1912 年以降発行分) を収録しています。 ・公報発行後、約 1 週間以内にデータが収録されます。 ・書誌情報 (特許出願人、発明者、特許情報、出願情報、優先権出願情報、関連出願情報、国際特許分類、共通特許分類、ヨーロッパ特許分類) と標題、抄録、全文情報 (詳細な説明、クレーム) が収録されています。 ・抄録は、オリジナル抄録もしくは対応特許由来の抄録が収録されています。発明の詳細な説明・クレームの品質が十分でない場合は、対応特許由来の発明の詳細な説明・クレームが収録されます。その場合、FA フィールドに DETD. E Q, CLM. EQ が収録されます。 ・すべての全文テキストフィールドにて、物性値検索が可能です。(約 1,800 種類の単位で表される 55 以上の物理学的・化学的物性値が対象) ・公報記載の出願番号、特許番号が /APO (出願番号, オリジナル), /PNO (特許番号, オリジナル) フィールドで検索可能です。 ・レコードは同一出願単位です。 ・INPADOCDB ファイルの特許ファミリーデータ (2004 年発行分まで) を表示できます。 ・古い年代の一部の公報は光学的文字読み取り (OCR) ソフトウェアで作成されているため、文字の誤入力やテキストが部分的に不完全な箇所があります。 		
レコード数	725,000 件以上 (イメージ数 161,000 件以上) (2019 年 3 月現在)		
収録年代	1912 年以降 (1912-1994 年は公告・登録特許 (特許種別 INA1) のみ収録)		
更新頻度	毎週更新		
言語	英語		
データベース	LexisNexis Univentio BV		
製作者	Galileiweg 8 2333 BE Leiden The Netherlands Phone: (+31) 88-6390000 E-mail: customersupport@univentio.com 著作権保有者		

ヨーロッパ
STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本
STN 東京
化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ
STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

データベース 代理店	FIZ Karlsruhe STN Europe P. O. Box 2465 76012 Karlsruhe Germany Phone: +49-7247-808-555 Fax: +49-7247-808-259 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
収録源	インド特許庁から発行された公開特許, 公告特許, 登録特許
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none">• STN 技術資料 https://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html• オンラインヘルプ => HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます• STNGUIDE ファイル
利用可能な クラスター	<ul style="list-style-type: none">• AEROTECH• ENGINEERING• PNTTEXT• ALLBIB• FULLTEXT• AUTHORS• HPATENTS• CORPSOURCE• PATENTS

検索フィールド

複数の検索語を AND 演算すると、すべての公報（一つのレコードは出願単位）を対象にそれらの語が検索されます。複数の検索語を (L) 演算すると、特定の公報内の検索に限定することができます。

例えば、S BOREHOLE/AB, TI, CLM (L) INA/PK で検索すると、INA の公報内に限定した検索になります。

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

一般検索フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
なし または /BI	基本索引 * 標題 (/TI), 抄録 (/AB), 詳細な説明 (DETD), クレーム (/CLM) (以上からの切出し語)	S TRANSISTOR AND ELECTRODE S ACOUSTIC SENSOR S ?TRANSFER?	TI, AB, DETD, CLM
/AB /AC /AD /AN /AP または APPS /APO /AY /CLM /CLMN /CPC /CPC. ACD /CPC. KW /CPC. VER /DED /DETN /DT または /TC /DUPD /ED /EDTX /EPC または /ECLA, /EPCLA /FA /GIS /GIT /IC /ICA /ICO /ICO. KW /ICM /ICS /IN または /AU /IN. CNY /IPC /IPC. KW /IPC. REF /IPC. VER /IPCI /IPCR /KT	抄録 * 出願国 (WIPO コードおよび国名) 出願日 ¹⁾ レコード番号 出願番号 ²⁾ 出願番号, オリジナル 出願年 ¹⁾ クレーム * クレームの数 ¹⁾ 共通特許分類 共通特許分類, 発効日 共通特許分類, キーワード 共通特許分類, 版 データ入力日 詳細な説明のパラグラフ数 ¹⁾ 資料種類 (コードおよびテキスト) データ更新日 入力日 ¹⁾ 入力日, 全文 ¹⁾ ヨーロッパ特許分類 ³⁾ フィールドの存在 イメージサイズ ¹⁾ イメージタイプ 国際特許分類 (ICM, ICS) 国際特許分類, 追加分類 ICO 分類 ³⁾ ICO, キーワード IPC, 主分類, 1-7 版 IPC, 副分類, 1-7 版 発明者 発明者, 国 (WIPO コードおよび国名) 国際特許分類 ³⁾ (IPCI, IPCR, ICM, ICS) 国際特許分類, キーワード 国際特許分類, リフォーム 国際特許分類, 版 国際特許分類, 発行時 国際特許分類, 再分類 Key Terms	S BOREHOLE/AB S IN/AC S AD=JAN 2008 S 2011000109/AN S IN 2010-CH1005/AP S IN1005CHE2010/APO S L1 AND AY>=2000 S DERIVATION/CLM S 5-7/CLMN S C12N0009/CPC S 20121113/CPC. ACD S C12N0009/CPC (S) I/CPC. KW S 20130101/CPC. VER S 20120113/DED S DETN<=9 S L1 AND P/DT S L1 AND PATENT/DT S 20120124/DUPD S ED=MAY 2013 S 20120326/EDTX S H02K0003-12/EPC S L1 AND AB/FA S L1 AND 2016/GIS S L1 AND TIFF/GIT S A45D/IC S C07C043-00/ICA S M07C0251-36/ICO S L01F3/04C5B60/ICO. KW S A62B037-00/ICM S A01M029-10/ICS S ZHANG TING/IN S L1 AND IN/IN. CNY S A01K0008/IPC S L1 AND INITIAL/IPC. KW S A01B0001-02/IPC. REF S H04B0007/IPC (P) 7/IPC. VER S B21B0001/IPCI S B21B0001/IPCR S "GLUCOSE AND GALACTOSE ABSORPTION" /KT	TI, AB, DETD, CLM AB AI AI AN AI APO AI CLM CLMN CPC CPC. TAB CPC. TAB CPC. TAB DED DETN DT DUPD ED EDTX EPC FA GIS GIT IC, ICM, ICS ICO ICO ICM ICS IN IN, IN. CNY IPCI, IPCR, ICM, ICS IPCI, IPCR IPCI, IPCR IPCI, IPCR, ICM, ICS IPCI IPCR KT

(続く)

■ 一般検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/LA /LAF	言語 (ISO コードおよび言語名) 出願言語 (ISO コードおよび言語名)	S L1 AND EN/LA S L1 AND EN/LAF	LA LAF
/MCLM /PA または /CS /PA. CNY /PAA /PC /PD /PHP	メインクレーム * 特許出願人 ⁴⁾ 特許出願人, 国 特許出願人, 住所 特許国 (WIPO コードおよび国名) 発行日 ¹⁾ 物性	S ?FRACTURE?/MCLM S HUAWEI TERMINAL/PA S L1 AND IN/PA. CNY S Gujarat/PAA S L1 AND IN/PC S PD=JAN-FEB 2013 S PHV/PHP (S) BUFFER/BI	MCLM PA PA, PA. CNY PA PI PI TI, AB, CLM, DETD
/PIT /PK /PN または /PATS /PNK /PNO /PRC /PRD /PRDF /PRN /PRNO /PRY /PRYF /PY /RLC /RLD /RLN /RLY /TI /UP	特許情報, 公報タイプ 特許種別コード 特許番号 ²⁾ 種別付き特許番号 特許番号, オリジナル 優先権主張国 (WIPO コードおよび国名) 優先権主張日 ¹⁾ 最先の優先権主張日 ¹⁾ 優先権主張番号 ²⁾ 優先権主張番号, オリジナル 優先権主張年 ¹⁾ 最先の優先権主張年 ¹⁾ 発行年 ¹⁾ 関連特許発行国 関連出願日 ¹⁾ 関連出願番号 ²⁾ 関連出願年 ¹⁾ 標題 * 更新日 ¹⁾	S INA APPLICATION/PIT S INA/PK (S) 2010/PY S IN2000CH00043/PN S IN2005CH00024 A/PNK S IN10005DELNP2007/PNO S L1 AND IN/PRC S L1 AND CHINA/PRC S 20030520/PRD S 20010614/PRDF S DE2004-202004000592/PRN S US10061642/PRNO S L1 AND 2003/PRY S L1 AND 2003-2004/PRYF S PY>2008 AND L1 S WO/RLC S 20050329/RLD S W02005-CN1990/RLN S 2005/RLY S FLUID###/TI S UP=MARCH 2012	PIT PI PI PI PNO PRAI PRAI PRAI PRAI PRAO PRAI PRAI RLN RLN RLN RLN TI UP

1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

3) シソーラスが利用できます。

4) このフィールドでは, (S) 演算子はスペースで代用できます。

■ スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは, スーパー検索コードを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると, クロスファイルおよびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

SEARCH コード	検索される フィールド	内容	入力例	DISPLAY コード
/APPS	/AP, /PRN	特許出願番号および優先権 出願番号 ¹⁾	S IN2011-CH1006/APPS	AI, PRAI APPS

1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

物性検索フィールド¹⁾

PHP フィールドを EXPAND すると、検索可能な物性がわかります。(入力例 : => E TEMP/PHP)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 ²⁾
/AOS	物質量	S 10/AOS	mol
/BIR	ビットレート	S 100000-160000/BIR	bit/s
/BIT	保存情報	S BIT>3 MEGABIT (10A) STORAGE	bit
/CAP	静電容量	S 1-10 MF/CAP	F
/CDN	電流密度	S CDN>10 A/M**2	A/m ²
/CMOL	モル濃度	S MOLYBD?/BI (S) 2/CMOL	mol/L
/CON	コンダクタンス	S 1E-2/CON	S (Siemens)
/DB	デシベル	S DB>50	dB
/DEG	角度	S (POLARI? (S) ANGLE)/BI (S) 45/DEG	° (degree)
/DEN	密度, 質量濃度	S (CELL? (S) RECOMBIN?) (S) 5E- 3-10E-3/DEN	kg/m ³
/DEQ	線量当量	S DEQ>0.5 (S) RADIATION	Sv
/DOS	投与量	S DOS>0.8	mg/kg
/DV	動的粘度	S DV>5000	Pa*s
/ECH	電荷	S 10-15/ECH (XA) CAPACITOR	C
/ECD	電荷密度	S 1-20/ECD (XA) ELECTRICAL	C/m ²
/ECO	電気伝導率	S ECO>1000 (XA) WIRE	S/m
/ELC	電流	S 1-10/ELC	A
/ELF	電場	S 1-5/ELF	V/m
/ENE	エネルギー	S L1 AND 10000/ENE	J
/ERE	電気抵抗率	S ERE>10 (P) ISOLAT?	Ohm*M
/FOR	力	S 50 N/FOR	N
/FRE	周波数	S ANALY? (10A) 0-3/FRE	Hz
/IU	国際単位	S IU>1000 (P) ANTIBIOTIC	IU
/KV	動粘性率	S LUBRICANT (S) 10E-5/KV	m ² /s
/LEN	長さ	S LUBRICANT/BI (S) 10E-5/KV	m
または /SIZ			
/LUME	照度	S 10-50/LUME	lx
/LUMF	光束	S L1 (S) LUMF>70	lm
/LUMI	光度	S 5<LUMI<15	cd
/M	質量	S ALLOY (30A) 1E-10-1E-5/M	kg
/MCH	質量電荷比	S 3/MCH	m/z
/MFD	磁束密度	S MFD>0E-3 (S) MAGNETIC RESONANCE	T
または /MFS			
/MFR	質量流量	S MFR<0E-3	kg/s
または /MFL			
/MM	モル質量, 分子量	S 2000-3000 G/MOL/MM	g/mol
/MOLS	質量モル濃度	S 0.1-10 mol/kg/MOLS	mol/kg
/MVR	メルトフローレート	S 5-10/MVR	g/10min
/NUC	栄養素含量	S NUC<100	g/100kcal
/PER	パーセント	S (TITAN? (3A) DIOXID?) (S) 5/PER	%
/PERA	誘電率	S 1-10/PERA	F/m
/PHV	水素イオン指数	S 7.4-7.6/PHV	pH
/POW	電力	S (SOLAR? OR PHOTOVOLTAIC?)/BI (10A) 5-10/POW	W
/PRES	圧力	S (VACUUM (5A) DISTILL?)/BI (S) 1000-1100/PRES	Pa
または /P			
/RAD	放射能	S RADI?/BI (P) 10-100/RAD	Bq
/RES	電気抵抗	S CERAMIC (P) 1-8/RES	Ω
/RSP	回転速度	S 7000-8000/RSP AND ENGINE	rpm

(続く)

物性検索フィールド (続き)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 ²⁾
/SAR	面積	S (COATING? OR FOIL?)/BI (S) 10-100/SAR	m ²
/SOL	溶解度	S SOL>20 (10W) WATER	g/100g
/STSC	表面張力, ばね定数	S 60 J/M**2/STSC	J/m ²
/TCO	熱伝導率	S 30-40/TCO (S) THERMO?	W/m K
/TEMP	温度	S (REACTION? (25A) PHOSPHAT?) (S) 10/TEMP	K
または /T			
/TIM	時間	S ?INCUB? (10W) 10-50/TIM	s
/VEL	速度	S PUMP?/BI (S) 1E-3-5E-3/VEL	m/s
または /V			
/VELA	角速度	S ANG?/CLM (S) VELA>10	rad/s
/VLR	体積流量	S 2-5/VLR (XA) TUBE	m ³ /s
/VOL	体積	S ?FUSION? (15A) 1E-8-2E-8/VOL	m ³
/VOLT	電圧	S CALIBRAT? (10A) 5E-3<VOLT<7E-3	V

1) 指数を用いて検索できます. 例: 18,000 は 1.8E+4 あるいは 1.8E4, 0.92 は 9.2E-1

2) 単位を省略して検索すると, デフォルト単位での検索となります.

国際特許分類 (/IPC) シソーラスの関係コード

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際, 下記の関係コードを利用できます.

国際特許分類シソーラスは 1967 年以降のレコードに対応しています.

関係コード	内容	入力例
ADVANCED (ADV)	入力した IPC に対応するアドバンスレベルの IPC (SELF, ADVANCED)	E G08C0019-00+ADVANCED /IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BR0/IPC
BT	上位語 (SELF, BT)	E C01F0001-00+BT/IPC
CORE (COR)	入力した IPC に対応するコアレベルの IPC (SELF, CORE)	E G08C0019-22+CORE/IPC
ED	入力語の完全な標題と IPC の版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01B0003-00+HIE/IPC
INDEX	入力語の完全な標題	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXT	次の分類	E C01C0001-00+NEXT/IPC
NEXT (n)	次の n 個の分類コード	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREV	前の分類	E C01C0001-12+PREV/IPC
PREV (n)	前の n 個の分類コード	E C01C0001-12+PREV6/IPC
RT (SIB)	関連語 (BT, SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

旧版 (第 1 版~第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は, /IPC に続けて各版の番号を入力します. (例: /IPC7)

ヨーロッパ特許分類 (/EPC) シソーラスの関係コード

ヨーロッパ特許分類 (/EPC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語, 簡略表示 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E C12M0001-34+ALL/EPC
AUTO ¹⁾	自動関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/EPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/EPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E SCRAPER BIASING MEANS+CODE/EPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/EPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E A01B0001+HIE/EPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/EPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01J0003-44+MAX/EPC
NEXT	次の分類	E A01B0001-24+NEXT/EPC
NEXT(n)	次の n 個の分類コード	E A01B0001-24+NEXT3/EPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/EPC
PREV	前の分類	E G05B0019-418N1+PREV/EPC
PREV(n)	前の n 個の分類コード	E G05B0019-418N1+PREV2/EPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/EPC

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

共通特許分類 (/CPC) シソーラスの関係コード

共通特許分類 (/CPC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語, 簡略表示 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E A61K0031-4375+ALL/CPC
AUTO ¹⁾	自動関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E C07D0473-40+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E C12N0009-6464+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E CARTRIDGES+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E F02M0031-047+HIE/CPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01R0022-066+MAX/CPC
NEXT	次の分類	E A01N0041-04+NEXT/CPC
NEXT(n)	次の n 個の分類コード	E A01N0041-04+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C07D0473-40+NT/CPC
PREV	前の分類	E F05C2253-16+PREV/CPC
PREV(n)	前の n 個の分類コード	E F05C2253-16+PREV2/CPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E F05B2250-313+TI/CPC

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例：=> D L1 1-5 TI PA

デフォルトでは、最新の公報の情報のみを表示します。後ろに .M をつけることで、レコード中の全公報の情報を表示することができます。（例外的に FA, FAM, CFAM, SCAN, TRIAL 表示形式では、後ろに .M はつけられません。）

特定の種別コードの情報に限定して表示する場合は、表示形式の末尾に . 特許種別コードを付与してください（例：D CLM.A）²⁾ が付与された表示形式で、この入力方法が使えます。

カスタム表示形式

DISPLAY コード	英語名	内容	入力例
AB (ABS)	Abstract	抄録	D TI AB 1-5
AI (AP) ¹⁾	Application Information	出願情報	D AI
AN	Accession Number	レコード番号	D L3 AN
APO	Application Number, Original	出願番号, オリジナル	D APO
CLM ²⁾	Claims	クレーム	D CLM
CLMN ³⁾	Number of Claims	クレームの数	D CLMN
CPC	Cooperative Patent Classification	共通特許分類	D CPC
DED	Data Entry Date	データ入力日	D DED
DETD ²⁾	Detailed Description	詳細な説明	D DETD
DETN ³⁾	Number of Paragraphs in DETD	詳細な説明の段落数	D DETN
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
DUPD	Data Update Date	データ更新日	D DUPD
ED	Entry Date	入力日	D ED
EDTX	Entry Date Full Text	入力日, 全文	D EDTX
EPC (ECLA, EPCLA)	EPC Classification	ヨーロッパ特許分類	D EPC
FA ³⁾	Field Availability	フィールドの存在	D FA
GI	Graphic Image	図面イメージ	D GI
GIS ³⁾	Graphic Image Size	図面イメージサイズ	D GIS
GIT ³⁾	Graphic Image Type	図面イメージタイプ	D GIT
ICA	IPC, Additional	IPC, 追加分類	D ICA
ICM	IPC, Main	IPC, 主分類, 1-7 版	D ICM
ICO	ICO Classification	ICO 分類	D ICO
ICS	IPC, Secondary	IPC, 副分類, 1-7 版	D ICS
IN (AU)	Inventor	発明者	D IN
IN.CNY	Inventor, Country	発明者, 国	D IN.CNY
IPCI	IPC, Initial	国際特許分類, 発行時	D IPCI
IPCR	IPC, Reclassified	国際特許分類, 再分類	D IPCR
KT	Key Terms	Key Terms	D KT
LA	Language	言語	D LA
LAF	Language of Filing	出願言語	D LAF
MCLM ²⁾	Main Claim	メインクレーム	D MCLM
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人	D PA
PA.CNY	Patent Applicant, Country	特許出願人, 国	D PA.CNY
PI (PN, PATS) ¹⁾	Patent Information	特許情報	D PI
PIT	Patent Information Publication Type	特許情報, 公報タイプ	D PIT
PNO ³⁾	Patent Number, Original	特許情報, オリジナル	D PNO
PRN (PRAI) ^{1), 4)}	Priority Information	優先権情報	D PRN
PRNO (PRAO) ^{3), 4)}	Priority Information, Original	優先権情報, オリジナル	D PRNO
RLI (RLN)	Related Patent Information	関連特許情報	D RLI
TI	Title	標題	D TI
UP	Update Date	更新日	D UP

(続く)

- 1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。
- 2) 末尾に .PK (特許種別コード) を付与して表示すると、特定の特許種別コードの情報に限定して表示できます。例: => D.CLM.A1
- 3) カスタム表示形式でのみ表示可能です。
- 4) 優先権情報がない場合、出願情報が代わりに収録されます。PRAI フィールドでは、アスタリスク (*) もあわせて付与されます。

定型表示形式

定型表示形式	内容	入力例
ALL ¹⁾	書誌情報, 特許分類, 抄録, 詳細な説明, クレーム AN, ED, UP, EDTX, DED, DUPD, TI, IN, IN.CNY, PA, PA.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLN, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, AB, DETD, CLM, KT (最新公報の情報)	D ALL
DALL ¹⁾	デリミタ型 ALL 形式	D DALL
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
ALLG ¹⁾	ALL, GI	D ALLG
IALLG ¹⁾	IALL, GI	D IALLG
APPS ¹⁾	AI, RLN, PRAI	D APPS
BIB ¹⁾	書誌情報 AN, ED, UP, EDTX, DED, DUPD, TI, IN, IN.CNY, PA, PA.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLN, PRAI (最新公報の情報)	D BIB
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBIB
BIBG ¹⁾	BIB, GI	D BIBG
IBIBG ¹⁾	IBIB, GI	D IBIBG
BRIEF ¹⁾	書誌情報, 抄録, メインクレーム AN, ED, UP, EDTX, DED, DUPD, TI, IN, IN.CNY, PA, PA.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLN, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, AB, MCLM, KT (最新公報の情報)	D BRIEF
IBRIEF ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BRIEF 形式	D IBRIEF
BRIEFG ¹⁾	BRIEF, GI	D BRIEFG
IBRIEFG ¹⁾	IBRIEF, GI	D IBRIEFG
CFAM ¹⁾	特許ファミリー情報 (特許番号のみ) AN, 特許番号 (INPADOC の情報)	D CFAM
CPC.TAB (無料)	共通特許分類の表形式 (最新公報の情報)	D CPC.TAB
FAM ¹⁾	特許ファミリー情報 AN, 特許ファミリー情報 (優先権情報と出願情報の対応表, 出願情報と特許情報の対応表 (INPADOC の情報))	D FAM
IC (無料)	国際特許分類 (IPC 1-7 の主分類, 副分類) ICM, ICS (最新公報の情報)	D IC
IND (無料)	索引情報 IPC (ICM, ICS, IPCI, IPCR), CPC, EPC, ICO (最新公報の情報)	D IND
IPC (無料)	国際特許分類, 全版 ICM, ICS, IPCI, IPCR (最新公報の情報)	D IPC
IPC.TAB (無料)	国際特許分類の表形式 (最新公報の情報)	D IPC.TAB
MAX (ALL.M) ¹⁾	レコードの全情報 (BIB+ABS+IND+CLM+DETD), 全公報の情報 AN, ED, UP, EDTX, DED, DUPD, TI, IN, IN.CNY, PA, PA.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLN, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, AB, DETD, CLM, KT	D MAX
IMAX (IALL.M) ¹⁾	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
MAXG (IALLG.M) ¹⁾	MAX, GI	D MAXG
IMAXG (IALLG.M) ¹⁾	IMAX, GI	D IMAXG

(続く)

定型表示形式 (続き)

DISPLAY コード	内容	入力例
SCAN ²⁾ (無料)	回答チェック用表示形式 TI (回答番号なしのランダム表示) (最新公報の情報)	D SCAN
STD ¹⁾	書誌情報と特許分類 AN, ED, UP, EDTX, DED, DUPD, TI, IN, IN.CNY, PA, PA.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLN, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO (最新公報の情報)	D STD
STD.M ¹⁾ (デフォルト)	書誌情報と特許分類 (全公報の情報)	D STD.M
ISTD ¹⁾	フィールド名付きインデント型 STD 形式	D ISTD
STDG ¹⁾	STD, GI	D STDG
ISTDG ¹⁾	ISTD, GI	D ISTDG
TRIAL (無料) (TRI, SAMPLE, SAM, FREE)	回答チェック用表示形式 AN, ED, UP, EDTX, TI, FA, DETN, CLMN (最新公報の情報)	D TRIAL
TX	全文情報 (詳細な説明, クレーム) DETD, CLM (最新公報の情報)	D TX

1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

2) SCAN 形式は、コマンドに続けて入力します。例: => D SCAN または => DISPLAY SCAN

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

ヒットタームに関する表示形式

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。(検索時にハイライト機能を ON にしておく必要があります。)

DISPLAY コード	内容	入力例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC (無料)	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

入力例：=> SEL L1 RN (回答セット L1 の回答全件から CAS 登録番号を抽出する)

=> ANA L1 1- PN (回答セット L1 の回答全件から特許番号を抽出する)

後ろに .M をつけることで、レコード中の全公報の情報を SELECT/ANALYZE することができます (AN, FA 以外)。

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。入力例：=> SORT L1 PD (回答セット L1 の回答全件を発行日の古い順に並び替える)

○ は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード, × は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AB	抄録	○	○
AC	出願国	○	○
AD	出願日	○	○
AN	レコード番号	○	○
AP (AI)	出願番号	○ ^{2), 3)}	○
APO	出願番号, オリジナル	○	○
APPS	出願番号グループ	○ ^{2), 4)}	○
AY	出願年	○	○
CLM	クレーム	○	×
CLMN	クレームの数	○	○
CPC	共通特許分類	○	○
DED	データ入力日	○	○
DETD	詳細な説明	○ ⁵⁾	×
DETN	詳細な説明のパラグラフ数	○	○
DT (TC)	資料種類	○ ⁶⁾	○
DUPD	データ更新日	○	○
ED	入力日	○	○
EDTX	入力日, 全文	○	○
EPC (ECLA, EPCLA)	ヨーロッパ特許分類	○ ⁷⁾	○
FA	フィールドの存在	○	×
GIS	図面イメージサイズ	○	○
GIT	図面イメージタイプ	○	○
IC	IPC (ICM, ICS), 1-7 版	○	×
ICM	IPC, 主分類, 1-7 版	○	○
ICO	ICO 分類	○	○
ICS	IPC, 副分類, 1-7 版	○	○
IN (AU)	発明者	○ ⁸⁾	○
IN.CNY	発明者, 国	○	○
IPC	国際特許分類	○	○
IPC.A	国際特許分類, アドバンストレベル	○ ⁹⁾	×
IPC.AI	国際特許分類, 発明情報の アドバンストレベル	○ ⁹⁾	×
IPC.F	国際特許分類, 第一分類 (第 8 版以降)	○ ¹⁰⁾	○
IPC.REF	国際特許分類, リフォーム	○	×
IPCI	国際特許分類, 発行時	○	○
IPCR	国際特許分類, 再分類	○	○
KT	Key Terms	○	×
LA	言語	○	○
LAF	出願言語	○	○
MCLM	メインクレーム	○	×

(続く)

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
OCC	ヒットタームの出現頻度	×	○
PA (CS)	特許出願人	○ ¹¹⁾	○
PA. CNY	特許出願人, 国	○	○
PAA	特許出願人, 住所	○	○
PC	特許発行国	○	○
PD	発行日	○	○
PIT	特許情報, 公報タイプ	○	○
PK	特許種別コード	○	○
PN (PI, PATS)	特許番号	○ ^{2), 12)} (デフォルト)	○
PNK	種別付き特許番号	○	○
PNO	特許番号, オリジナル	○	○
PRC	優先権主張国	○	○
PRD	優先権主張日	○	○
PRDF	最先の優先権主張年	○	○
PRN (PRAI)	優先権主張番号	○ ^{2), 13)}	○
PRNO (PRAO)	優先権情報, オリジナル	○ ¹⁴⁾	○
PRY	優先権主張年	○	○
PRYF	最先の優先権主張年	○	○
PY	発行年	○	○
RLC	関連特許発行国	○	○
RLD	関連出願日	○	○
RLN (RLI)	関連出願番号	○ ^{2), 15)}	○
RLY	関連出願年	○	○
TI	標題	○	○
UP	更新日	○	○

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例: => SEL HIT IN

2) SELECT, ANALYZE, SORT された出願番号, 優先権主張番号, 特許番号は SET PAT STN あるいは DERWENT で設定した形式で表示されます.

3) 抽出されたタームに /AP が付与されます.

4) 出願番号と優先権主張番号が SELECT または ANALYZE され, /APPS が付与されます.

5) 抽出されたタームに /BI が付与されます.

6) 抽出されたタームに /DT が付与されます.

7) 抽出されたタームに /EPC が付与されます.

8) 抽出されたタームに /IN が付与されます.

9) 抽出されたタームに /IPC. REF が付与されます.

10) 抽出されたタームに /IPC が付与されます.

11) 抽出されたタームに /PA が付与されます.

12) 抽出されたタームに /PN が付与されます. PATS を用いて SELECT および ANALYZE した場合, 抽出されたタームに /PATS が付与されます.

13) 抽出されたタームに /PRN が付与されます.

14) 抽出されたタームに /PRNO が付与されます.

15) 抽出されたタームに /RLN が付与されます.

サンプルレコード

MAX (ALL. M) 表示形式

レポート番号	AN	2005012809	INFULL	ED	20130525	UP	20130525	EDTX	20130525	<u>Full-text</u>
		DED	20100220	DUPD	20130422					
標題	TI	SYSTEM AND PROBE FOR DETECTING AT LEAST ONE PARAMETER								
発明者名	IN	CRISTIANI, CORRADO								
特許出願人	PA	ANGELO PO GRANDI CUCINE-SOCIETA' PER AZIONI, STRADA STATALE ROMANAN 90, 41012 CARPI (MO), ITALY Italy								
出願言語	LAF	English								
言語	LA	English								
資料種類	DT	Patent; (Fulltext)								
特許情報, 公報タイプ	PIT	INA APPLICATION								
特許情報	PI	IN 2005DE01768		A		20070803				
出願情報	AI	IN 2005-DE1768				20050707				
優先権出願情報	PRAI	IT 2004-M0193				20040723				
国際特許分類 (発行時)	IPC1	G01R0001-067 [C]								

抄録 AB

Original

A probe for detecting at least one parameter during thermal treatment of a food product (2) comprises sensor means (7), suitable for detecting a value of said at least one parameter, antenna means (9) for communicating said value to a control device (11) for controlling said thermal treatment in the absence of connecting cables and supply means of a different type from the electrochemical type.

詳細な説明 DETD

The invention relates to a probe for detecting at least one parameter during a thermal treatment process of a food product, for example during a cooking process, freezing process or conservation process of such a product. The invention furthermore relates to a detecting system provided with the aforementioned probe and to a cooking apparatus and a conservation apparatus equipped with such a system.

Each parameter measured by the detecting system or the probe according to the invention may be a physical, mechanical or electric parameter such as for example temperature, impedance, humidity, pressure or density. Each parameter can be measured at one or more points arranged on the external surface or inside the food product, which may be of solid or liquid type.

Detecting system for detecting the temperature of a food product during a cooking process are known, comprising a probe that is suitable for

:

クレーム CLM

Probe for detecting at least one parameter during thermal treatment of a food product (2), comprising sensor means (7) suitable for detecting a value of said at least one parameter, antenna means (9) for communicating said value to a control device (ii) for controlling said thermal treatment in the absence of connection cables, characterised in that said probe (3; 103; 203; 303) comprises supply means of a different type from the electrochemical type.

2. Probe according to claim wherein said supply means comprises supply circuit means (26, 27; 127; 227; 327) suitable for transforming into electric energy electromagnetic energy associated with a signal transmitted to said antenna means (9) by said control device (ii).

3. Probe according to claim 2, wherein said supply circuit means (26, 27; 127; 227; 327) comprises a supply circuit (27; 127; 227; 327) connected to said sensor means (7).

4. Probe according to claim 3, and furthermore comprising activating means for selectively activating said supply circuit (27; 127; 227; 327)

:

■ MAX (ALL.M) 表示形式 (続き)

レコード番号 AN 2005012809 INFULL ED 20130525 UP 20130525 EDTX 20130525
 DED 20130422 DUPD 20130503
 標題 TI PROBE FOR DETECTING AT LEAST ONE PARAMETER DURING THERMAL TREATMENT OF
 FOOD PRODUCT
 特許出願人 PA ANGELO PO GRANDI CUCINE-SOCIETA' PER AZIONI
 出願言語 LAF English
 資料種類 DT Patent; (Fulltext)
 特許情報, 公報タイプ PIT INA1 PATENT
 特許情報 PI IN 255992 A1 20130419
 出願情報 AI IN 2005-DE1768 20050707
 優先権出願情報 PRAI IN 2005-DE1768 20050707

抄録 AB

Equivalent from IN1768DEL2005A
 A probe for detecting at least one parameter during thermal treatment of a food product (2) comprises sensor means (7), suitable for detecting a value of said at least one parameter, antenna means (9) for communicating said value to a control device (11) for controlling said thermal treatment in the absence of connecting cables and supply means of a different type from the electrochemical type. :

詳細な説明 DETD

The invention relates to a probe for detecting at least one parameter during a thermal treatment process of a food product, for example during a cooking process, freezing process or conservation process of such a product. The invention furthermore relates to a detecting system provided with the aforementioned probe and to a cooking apparatus and a conservation apparatus equipped with such a system.

Each parameter measured by the detecting system or the probe according to the invention may be a physical, mechanical or electric parameter such as for example temperature, impedance, humidity, pressure or density. Each parameter can be measured at one or more points arranged

Detecting system for detecting the temperature of a food product during a cooking process are known, comprising a probe that is suitable for
 :

クレーム CLM

Probe for detecting at least one parameter during thermal treatment of a food product (2), comprising sensor means (7) suitable for detecting a value of said at least one parameter, antenna means (9) for communicating said value to a control device (ii) for controlling said thermal treatment in the absence of connection cables, characterised in that said probe (3; 103; 203; 303) comprises supply means of a different type from the electrochemical type. Probe according to claim wherein said supply means comprises supply circuit means (26, 27; 127; 227; 327) suitable for transforming into electric energy electromagnetic energy associated with a signal transmitted to said antenna means (9) by said control device (ii) Probe according to claim 2, wherein said supply circuit means (26, 27; 127; 227; 327) comprises a supply circuit (27; 127; 227; 327) connected to said sensor means (7) Probe according to claim 3, and furthermore comprising activating means for selectively activating said supply circuit (27; 127; 227; 327) at certain preset instants. Probe according to claim 4, wherein said activating means is
 :

CFAM 表示形式

PATENT FAMILY INFORMATION INPADODGB COPYRIGHT 2013 EPO / FIZ KARLSRUHE on STN
 レポート番号 AN 1986000956 INFULL

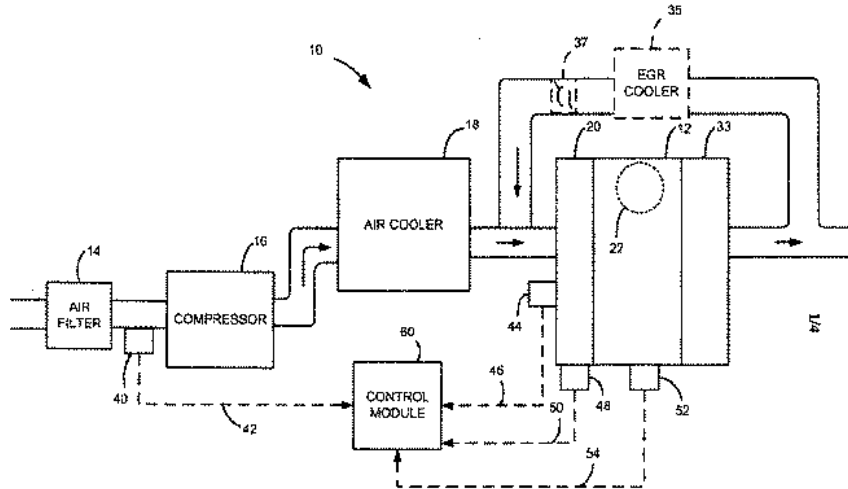
特許情報 +-----PI-----+
 (特許ファミリー) CA 1288256 C 19910903
 EP 226856 A2 19870701
 EP 226856 A3 19880907
 IN 165989 A1 19900217
 IN 168564 A1 19910427
 US 5068196 A 19911126

4 priorities, 5 applications, 6 publications

STDG.M 表示形式

レポート番号 AN 2007000469 INFULL ED 20130525 UP 20130525 EDTX 20130525
 DED 20100221 DUPD 20120523
 標題 TI METHOD FOR DYNAMIC MASS AIR FLOW SENSOR MEASUREMENT CORRECTIONS
 発明者 IN YUN XIAO
 特許出願人 PA GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC., 300 GM RENAISSANCE CENTER,
 DETROIT, MICHIGAN 48265-3000, U. S. A.
 出願言語 LAF English
 資料種類 DT Patent: (Fulltext)
 特許情報, 公報タイプ PIT INA APPLICATION
 特許情報 PI IN 2007K001477 A 20080523
 出願情報 AI IN 2007-K01477 20071029
 優先権出願情報 PRAI US 2006-466862 20061103
 国際特許分類 IPCI F02D0041-18 [C]; F02D0041-14 [C]
 (発行時)

図面



レポート番号 AN 2007000469 INFULL ED 20130525 UP 20130525
 DED 20120523 DUPD 20120523
 標題 TI A MASS AIR FLOW SENSOR MEASUREMENT CORRECTION SYSTEM AND A METHOD OF
 CORRECTION FOR A TURBO CHARGED DIESEL ENGINE OPERATING UNDER TRANSIENT
 CONDITIONS
 発明者 PA GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC.
 特許出願人 LAF English
 資料種類 DT Patent
 特許情報, 公報タイプ PIT INA1 PATENT
 特許情報 PI IN 250016 A1 20111202
 出願情報 AI IN 2007-K01477 20071029
 優先権出願情報 PRAI IN 2007-K01477 20071029